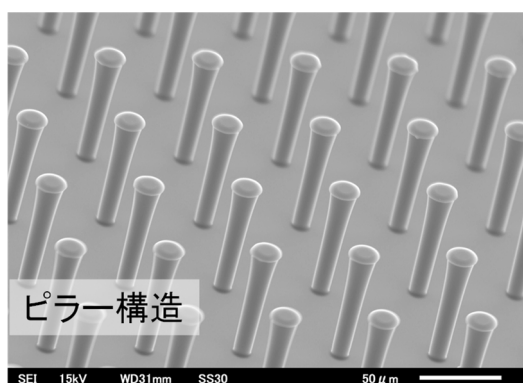
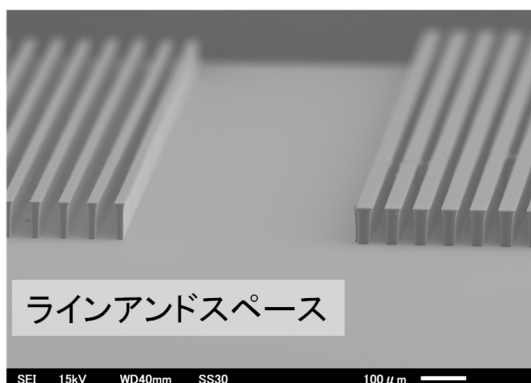




ナノ・マイクロスケールの微細加工入門シリーズ

装置動画で学ぶリソグラフィ工程

～スピコート・露光・現像を中心に～



日時

2024年7月23日(火)

～ 2024年7月29日(月)

(上記視聴期間内であれば、何回でも視聴可能です。)

申込締切日

2024年

7月9日

(火)

定員

20名

受講料

1,000円

特徴

- ・実際の動画で装置や実験の様子を視聴可能
- ・微細加工、微細構造形成に関心のある方向け
- ・リソグラフィ技術初心者の方にも最適

詳細は裏面またはこちら



お問合せ先

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 技術振興室 技術セミナー係
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 TEL:03-5530-2308
メール宛先: kenshu@iri-tokyo.jp

技術セミナー（オンデマンド配信）

装置動画で学ぶリソグラフィ工程 ～スピコート・露光・現像を中心に～

概要

半導体・MEMS センサや、光回折格子、マイクロ流路チップなどにみられる微細構造の製造工程では、紫外線フォトリソグラフィや、電子線リソグラフィ、ナノインプリントリソグラフィといったナノ～マイクロメートルスケールのパターンニング技術が利用されています。本オンデマンド配信では、当センターの加工設備を用いた実験室レベルでのリソグラフィ工程の動画を交えて紹介し、入門知識の解説を行います。また、ガラス基板に成膜された金属薄膜をウェットエッチングして作る光学回折格子の試作工程を紹介し、理解を深めていただきます。これから微細加工やリソグラフィ技術の知識を深めたいと考えている方のご参加をお待ちしております。

※1 本配信の内容は、過去（2021～2023年度）に配信された「MEMS 微細加工入門Ⅰ・リソグラフィ」、及び「ナノ・マイクロスケールの微細加工入門シリーズ・装置動画で学ぶリソグラフィ工程」と同等のものです。

※2 本配信の解説は音声読み上げソフトを使用しています。

※3 配信動画の著作権は都産技研に帰属します。録音・録画はご遠慮ください。

プログラム

配信時間	タイトル	講師
約60分	【講義】 1. リソグラフィ技術の概要 2. フォトリソグラフィ技術の工程 3. その他のリソグラフィ技術 (電子線リソグラフィ・ナノインプリントリソグラフィ) 4. 加工事例の紹介	東京都立産業技術研究センター 電気技術グループ 宮下 惟人

募集要項

- 利用約款** 下記ウェブページでご確認ください。
<https://www.iri-tokyo.jp/soshiki/52/yakkan.html>
- 応募資格** 原則として、日本の法人の従業員、個人事業主または創業を予定している個人
- 申込締切** 2024年7月9日(火) ※定員を超えた場合は期日前に締め切ることがあります。
- 申込方法** 下記ウェブページの申込フォームから、お申込みください。
<https://www.iri-tokyo.jp/seminar/240723.html>
- 受講可否** 受講予定者には、請求書およびコンビニ払込書を郵送いたします。
定員などの関係で受講をお断りする場合、電話または電子メールでご連絡いたします。

参加方法

- 受講料のご入金確認後、視聴期間開始日までに電子メールで視聴 URL・パスワード並びに、テキストのダウンロード URL・閲覧パスワードを送付いたします(テキストは郵送になる可能性があります)。
※申込者・受講者が第三者に上記 URL などを貸与、譲渡、売却等することは禁止されています。
- 視聴環境(パソコンなど)は、受講者をご準備ください。
- ブラウザは、Microsoft® Edge^{※1}または Google chrome^{TM※2}をご使用ください。
^{※1※2}Microsoft® Edge はマイクロソフト社の登録商標で、Google chromeTM はグーグル社の商標です。